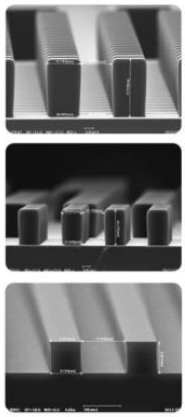
Nano Pajouhan Raga Co.

MA 200 Mask Aligner

لیتوگرافی تنظیم کننده ماسک فرآیندی است که طی آن طرح و الگوی دلخواه را با دقت بالا بر روی سطح مورد نظر ایجاد می‌کنند. دسترسی به دقتهای بالا، و رود به دنیای میکروسکوپی، سرعت پاسخ دهی بالا، اندازه کوچک قطعات و هزینه پایین ازجمله ویژگیهای این روش می‌باشند.

لیتوگرافی در گستره وسیعی از صنایع کاربرد فراوانی دارد که از آن جمله می‌توان به ساخت انواع حسگرها نظیر شتاب سنجها، فشار سنجها و نیز انواع محرکها اشاره کرد. یکی کاربردهای دیگر این دستگاه در ساخت آزمایشگاههای میکرومتری بر روی یک تراشه می‌که امروزه در دنیا گسترش فروانی پیدا کرده است.



- ✓ منبع نوری با طول موج ۳۶۵ نانومتر(i-line) به منظور استفاده از تمامی رزیستها.
- ✓ دارای منبع نوری با طول عمر بالا
- ✓ دارای لنزهای با فواصل کانونی مختلف
- ✓ لیتوگرافی با دقت ۵ میکرومتر
- ✓ سطح موثر قابل الگودهی یک ویفر ۲ و یا ۴ اینچی بصورت اختیاری
- ✓ کنترل دقت با میکروسکوپ دیجیتالی از طریق صفحه نمایش
- ✓ دارای قابلیت کنترل شدت و زمان نوردهی به نمونه
- ✓ دارای موازی‌ساز عمیق با تلفیق عدسیها و فیلتهای مختلف نور برای ایجاد الگو دقیق
- ✓ قابلیت ایجاد الگوهایی بر روی فوتو رزیستهای ضخیم تا عمق ۱۰۰ میکرومتر
- ✓ قابلیت جابجایی ماسک با دقت ۲ میکرومتر در چهار درجه آزادی z, teta، بصورت دستی
- ✓ قابلیت تثبیت نمونه بوسیله وکیوم